

微分干涉显微镜



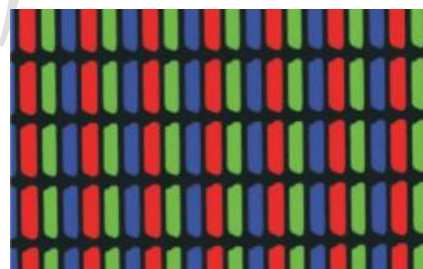
型号： MX-4RT

1. 用途 【Usage】

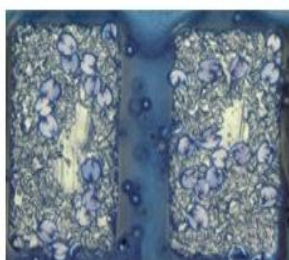
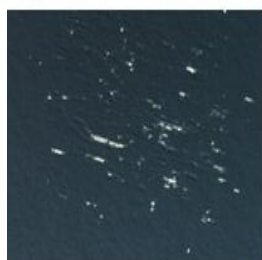
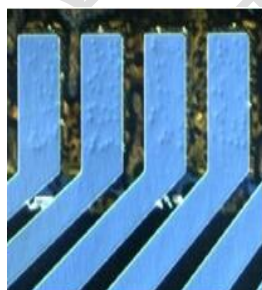
MX-4RT是最新型FPD检查显微镜，专为LCD行业TFT玻璃COG导电粒子压痕检查设计，具有成像清晰，工作距离长，使用便利，应用软件丰富的特点，是一款性价比非常优秀的半导体及微电子工业与科研用显微镜，其微分干涉效果可完全与进口品牌相媲美。

2. 特点 【Characteristic】

- 采用无限远色差校正光学系统
- 长工作距、明暗场两用平场消色差物镜，成像清晰、像面平坦
- 配备反射式柯拉照明系统，为不同倍率的物镜提供均匀充足的照明
- 倒像三通观察筒，25° 倾斜，极大的提高了观察的舒适性与操作的适应性
- 最佳人机学设计，高刚性镜筒，“Y”型底座，调焦机构采用前置式操作控制，精微调同轴
- 光源采用宽电压数字调光技术，具有光强调定与复位功能
- 可选配摄影摄像装置、简易偏光装置、干涉滤光片、测微尺等附件，拓展应用领域



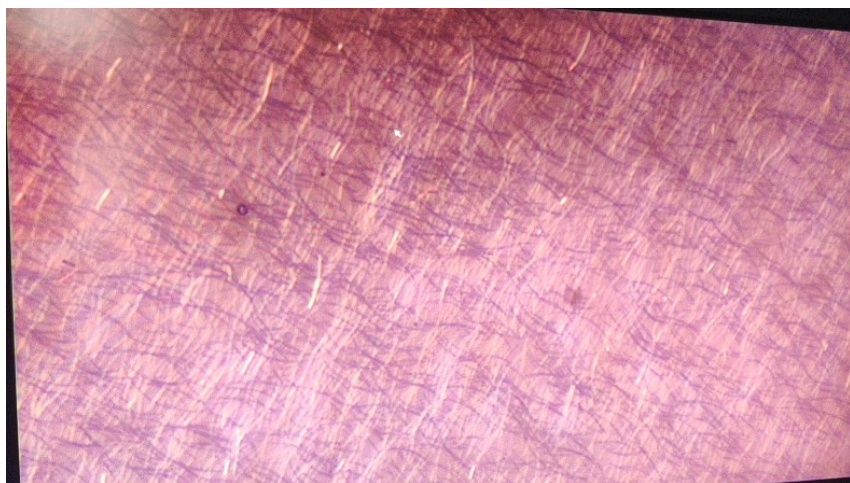
LCD 10X 透射光



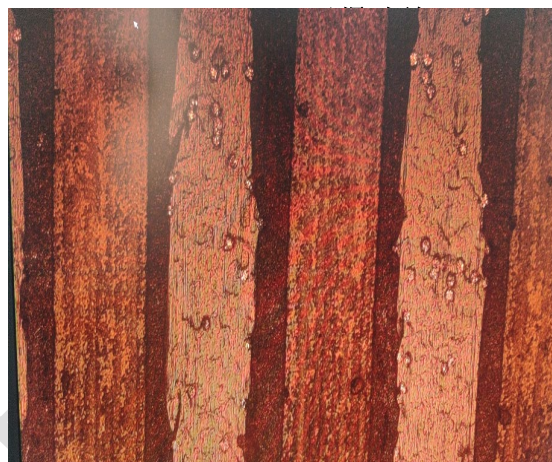
选配微分干涉DIC可观察图一、图二效果

3. 可同时满足多种应用需求

500x纳米银效果



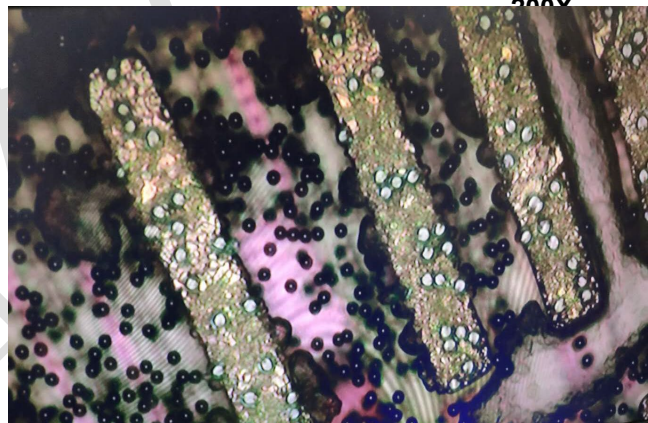
100x 粒



50X ITO导线、TP模组检测



200X



200X 导电粒子爆破形状
(菲林)



200X 导电粒子爆破形状
(菲林)



4. 技术参数【Technical Parameter 】

配 置	参 数
光学系统	无限远色差校正光学系统
观察方法	明场/斜照明/偏振光/DIC
观 察 筒	倒像观察筒，25° 铰链式三目，分光比，双目：三目=100： 0 或 0： 100
目 镜	PL10X/22 平场高眼点目镜
转 换 器	5 孔内倾式转换器
物 镜	无限远长工作距明场金相物镜 5X LMPL5X /0.15 WD9mm
	无限远长工作距明场金相物镜 10X LMPL10X /0.3 WD9mm
	无限远长工作距明场金相物镜 20X LMPL20X /0.45 WD3.4mm
	无限远长工作距明场半复消金相物镜 50X LMPLFL50X /0.55 WD7.5mm
调焦机构	粗微调同轴、粗调行程 33mm，微调精度 0.001，带粗调机构上限位及松紧调节装置。 内置 90-240V 宽电压变压器，单路电源输出
载 物 台	三层机械移动平台，配大台面尺寸可达 320*214mm，行程 105mm，右手位 X、Y 移动手轮
反射照明系统	LED 透射光源，带可变视场光，均可调中心；带滤色片插槽与偏光装置插；，预置中心，采用数字调光，具有光强设定与复位功能
偏光附件	检偏镜可 360 度旋转，起偏镜和检偏镜均可移出光路
CTV 接口	1X
CCD	高清 1080P 无延迟彩色工业相机,帧率可达 60 帧，内嵌基本测量功能，满足大部分需求
显示器	21.5 寸高清液晶显示器（HDMI 接口）
选配附件	微分干涉片 DIC（用于玻璃液晶模组观察导电粒子压痕）